

Молекулярные состояния адсорбции и вероятность прилипания молекул D_2 на поверхности W(110) при температуре жидкого гелия

В. Д. Осовский, Ю. Г. Птушинский, В. Г. Сукретный, Б. А. Чуйков

Институт физики НАН Украины, Украина, 252022, г. Киев, пр. Науки, 46
E-mail:osov@marion.iop.kiev.ua

Статья поступила в редакцию 21 октября 1996 г.

Измерены зависимости коэффициента прилипания молекул D_2 на поверхности вольфрама W(110) от степени покрытия $S(\theta)$ при температуре подложки $T_s \sim 5$ К при различных условиях формирования адсорбированного слоя. Обнаруженный ранее (В. Д. Осовский и др., *Письма в ЖЭТФ* **60**, 569 (1994)) эффект значительного повышения вероятности прилипания D_2 при заселении слабосвязанных состояний физической адсорбции существенно усиливается на поверхности, покрытой упорядоченным монослоем атомов дейтерия, и в еще большей степени – при адсорбции на поверхности, покрытой атомарным и физически адсорбированным молекулярным монослоями. Наблюдаемые особенности зависимости $S(\theta)$ при $T_s \sim 5$ К объясняются с учетом островкового характера роста адсорбированного слоя и участия предсостояния в процессе его формирования. Получены также зависимости $S(\theta)$ для $T_s = 78$ и 300 К, свидетельствующие о ленгмюровском механизме адсорбции при заселении атомарного состояния 550 К и об адсорбции через предсостояние при формировании состояния 410 К.

Виміряно залежності коефіцієнта прилипання молекул D_2 на поверхні вольфрама W(110) від ступеня покриття $S(\theta)$ при температурі підкладки $T_s \sim 5$ К за різних умов формування адсорбованого шару. Виявлений раніше (В. Д. Осовський та ін., *Письма в ЖЭТФ* **60**, 569 (1994)) ефект значного підвищення ймовірності прилипання D_2 при заселенні слабкоузяних станів фізичної адсорбції істотно підсилюється на поверхні, вкритій упорядкованим моношаром атомів дейтерія, і в ще більшій мірі – при адсорбції на поверхні, вкритій атомарним та фізично адсорбованим молекулярним моношарами. Спостережені особливості залежності $S(\theta)$ при $T_s \sim 5$ К пояснюються з урахуванням островцевого характеру росту адсорбованого шару і участі передстану в процесі його формування. Отримано також залежності $S(\theta)$ для $T_s = 78$ та 300 К, що свідчать про ленгмюрівський механізм адсорбції при заселенні атомарного стану 550 К і про адсорбцію через передстан при формуванні атомарного стану 410 К.

PACS: 68.45.Da

Введение

Изучение адсорбции водорода на поверхности металлов представляет большой интерес в связи с проблемами растворения и накопления его в металлах как экологически чистого топлива, водородного окрупчивания металлов и т.п. Малый размер и масса атома и молекулы водорода, а также двукратное различие масс изотопов (без учета трития) позволяют рассчитывать на проявление особых эффектов при его взаимодействии с поверхностью, не свойственных более крупным молекулам.

Особенно интересно проведение исследований при низких температурах, когда могут быть стационарно заселены и изучены слабосвязанные состояния физической адсорбции, а также могут проявиться квантовые эффекты. Слабосвязанные молекулярные состояния адсорбции часто выступают в роли предсостояний в механизме диссоциативной адсорбции, являющейся ключевой стадией перечисленных в начале статьи процессов. Поэтому изучение низкотемпературной адсорбции изотопов водорода является весьма актуальной задачей.

Адсорбция водорода на поверхности металлов довольно обстоятельно изучена [1], однако это не относится к области низких температур подложки. Опубликовано лишь незначительное количество работ по низкотемпературной адсорбции водорода, в которых в основном изучалась симметрия адсорбированного слоя, подвижность адсорбированных частиц и фазовые переходы при температурах близких к температуре жидкого гелия [2–8]. Нами опубликовано несколько работ, в которых получены данные о спектрах и кинетике заселения слабосвязанных состояний адсорбции водорода [9–13]. В частности, в работе [13] был обнаружен эффект резкого повышения вероятности прилипания молекул D_2 на поверхности W(110) при температуре подложки $T_s \sim 5$ К в процессе заселения слабосвязанных состояний молекулярной адсорбции. Указанный эффект был интерпретирован как следствие повышенной эффективности рассеяния кинетической энергии падающей молекулы при ее ударе о ранее адсорбированную слабосвязанную молекулу по сравнению с ударом о чистую поверхность или покрытую жестко связанными адсорбированными атомами. В настоящей работе, проведя эксперименты с многократным заселением и опустошением слабосвязанных адсорбированных состояний, мы обнаружили существенное усиление указанного эффекта. Для сравнения получены также данные о вероятности прилипания молекул D_2 при $T_s \approx 78$ и 300 К.

Методика эксперимента

Эксперименты проводились на сверхвысоковакуумной установке типа «черной камеры» методами молекулярного пучка и термодесорбционной спектроскопии. Методика эксперимента подробно описана в [12, 14]. Коэффициент (вероятность) прилипания S определялся по зависимости интенсивности потока рассеянных или десорбированных с поверхности образца молекул от времени адсорбции [15]:

$$S(t) = 1 - I(t)/I_m, \quad (1)$$

где $I(t)$ и I_m — ионные токи детектора рассеянных молекул соответственно в момент

времени t и после достижения полного отражения молекул от насыщенной поверхности образца.

Степень покрытия $\theta = n/n_0$ (n — поверхностная концентрация адсорбированных частиц; $n_0 \sim 1,4 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-2}$ — концентрация поверхностных атомов подложки) определялась по временной зависимости S из выражения

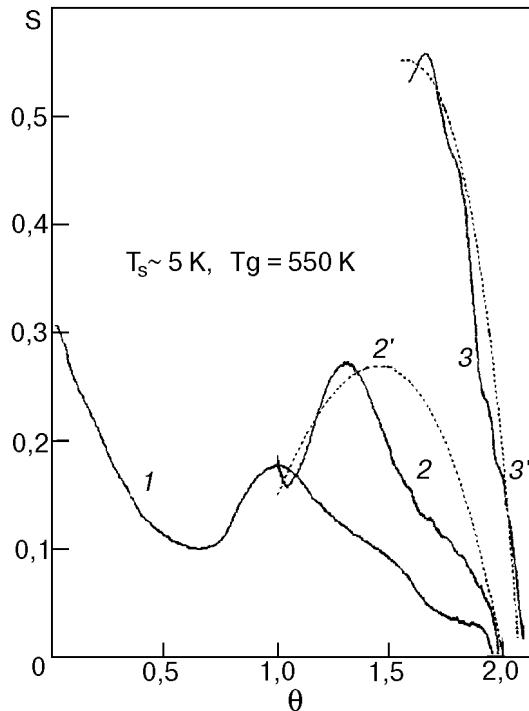
$$\theta = v/n_0 \int_0^t S(t) dt, \quad (2)$$

где v — газокинетический поток молекул на поверхность образца. В наших предыдущих работах [9–13] приведена величина θ в относительных единицах, так как мы не измеряли интенсивность потока v . Однако, воспользовавшись данными [2, 16] о том, что при насыщении атомарной фазы адсорбции водорода на поверхности W(110) степень покрытия $\theta = 1$, можно определить коэффициент пропорциональности между величиной θ и площадью, ограниченной кривой $S(t)$. С помощью подобной калибровки в настоящей работе получены абсолютные значения θ . Подобный способ оценки θ является приближенным и не учитывает возможной ошибки при регистрации молекул, рассеянных холодной поверхностью или термически десорбированных.

Результаты эксперимента и их обсуждение

На рис. 1 показаны зависимости $S(\theta)$ при $T_s \sim 5$ К для трех различных процессов. Первый процесс (кривая 1) соответствует адсорбции D_2 на первоначально чистую поверхность W(110). В данном эксперименте температура газа $T_g = 550$ К и значение начального коэффициента прилипания ($\theta = 0$) $S_0 \sim 0,3$ приблизительно соответствует зависимости $S_0(T_g)$ [13]. Наиболее характерная особенность зависимости $S(\theta)$ — возрастание S с началом заселения слабосвязанных состояний физической адсорбции — имеет место при $T_g = 550$ К, как и при более низких T_g [13]. Для удобства на рис. 2 воспроизведен из [13] спектр термодесорбции адсорбированного слоя D_2 , насыщенного при $T_s \sim 5$ К. В [13] мы предположили, что слабосвязанные состояния молекулярной адсорбции 15 К и 8 К* соответствуют второму и третьему монослоям,

* Как и в [13], состояние адсорбции мы обозначаем температурой пика в спектре термодесорбции.



Rис. 1. Зависимость коэффициента прилипания молекул D_2 от степени покрытия: первоначально чистая поверхность (1); поверхность, первоначально покрытая монослоем атомарного дейтерия (2); поверхность, дополнительно покрытая монослоем молекулярного дейтерия (3); 2' и 3' – расчетные зависимости.

однако пик 15 К в спектре термодесорбции очень мал по сравнению с пиком 8 К, и мы считаем, что оба эти состояния соответствуют второму монослою. Возможно, появление двух пиков при термодесорбции молекул из одного и того же слоя связано с наличием дефектов структуры поверхности или с тем, что адсорбированный слой является двухфазным, состоящим из двумерных конденсированных островков и двумерного газа. Поэтому в дальнейшем мы не будем обсуждать состояние 15 К, как не содержащее существенного количества молекул D_2 .

Второй процесс (кривая 2) – это адсорбция D_2 при $T_s \sim 5$ К в условиях, когда после завершения первого процесса образец был отожжен при 300 К. Как показано в [2], вследствие такого отжига поверхность W(110) остается покрытой упорядоченным моноатомным слоем дейтерия*. Видно, что область резкого возрастания S сместилась в сторону больших θ , а максимальное значение S существенно возросло.

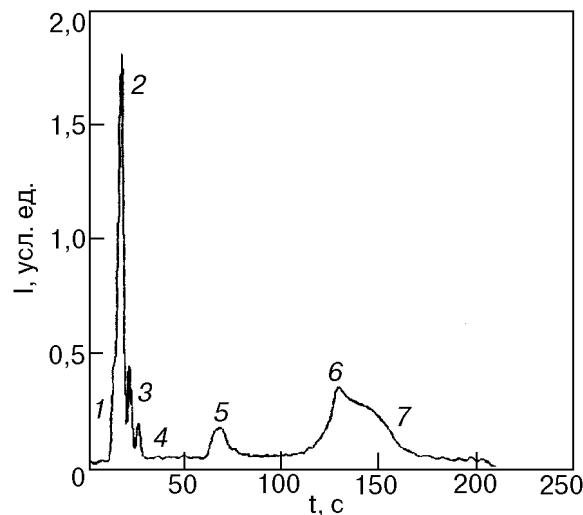


Рис. 2. Спектр термодесорбции D_2 . Температуры пиков десорбции T_d , К: 5 (1); 8 (2); 15 (3); 60 (4); 150 (5); 410 (6); 550 (7).

Причину наблюдаемого различия зависимостей 1 и 2 мы видим в том, что в первом процессе из-за островкового механизма роста атомарного слоя слабосвязанные состояния адсорбции D_2 заселяются еще до того, как вся поверхность будет покрыта атомарным слоем. Поэтому условия для возрастания коэффициента прилипания наступают при меньших значениях суммарной θ , чем во втором процессе, когда слабосвязанные состояния адсорбции формируются поверх уже образовавшегося моноатомного покрытия. Характер зависимости $S(\theta)$ для этого процесса свидетельствует о том, что в заполнении второго монослоя участвует предстояние, скорее всего, состояние 5 К.

Третий процесс (кривая 3) представляет собой адсорбцию D_2 после изотермической десорбции из состояния 5 К, происходящей при перекрытии молекулярного пучка. Молекулы D_2 недерживаются стационарно в состоянии 5 К, и некоторое их количество присутствует на поверхности при открытом молекулярном пучке вследствие динамического равновесия между адсорбцией и десорбией. Уменьшение степени покрытия после перекрытия молекулярного пучка определялось из временной зависимости тока детектора после перекрытия молекулярного пучка.

Как видно из рис. 1, при включении молекулярного пучка после паузы перекрытия

* В [2] эксперименты проведены с водородом, однако нет оснований полагать, что в случае дейтерия ситуация будет иной.

коэффициент прилипания существенно превышает таковой для чистой поверхности. Мы считаем, что большая величина S в начале третьего процесса определяется, во-первых, тем, что перед включением молекулярного пучка поверхность практически полностью покрыта слабосвязанными молекулами в состоянии 8 К, которые обеспечивают эффективную потерю кинетической энергии падающих молекул и поэтому большую вероятность захвата. Во-вторых, в начале третьего процесса еще отсутствуют молекулы в состоянии 5 К и скорость их испарения, уменьшающая измеряемый коэффициент прилипания, равна нулю. Во втором процессе, вероятно, вследствие островкового характера роста второго монослоя (состояние 8 К) адсорбционное состояние 5 К заселяется еще до образования полного монослоя 8 К, и на этом этапе происходит интенсивное испарение молекул D_2 .

Феноменологическое рассмотрение процесса адсорбции через предсостояние и при различных значениях коэффициентов прилипания над занятым и свободным местами было проведено Ждановым [17] при некоторых упрощающих предположениях и получено следующее уравнение для коэффициента прилипания:

$$S = (1 - \theta_2)S_e + \theta_2 S_f K_{fe}(1 - \theta_2) / [K_{fe}(1 - \theta_2) + K_{fd}], \quad (3)$$

где S_e и S_f — коэффициенты прилипания над свободным и занятым местами соответственно; K_{fe} — константа скорости перехода молекул из предсостояния над занятым местом в предсостояние над свободным местом; K_{fd} — константа скорости десорбции из предсостояния над занятым местом; θ_2 — степень покрытия во втором монослое.

На рис. 1 пунктирной кривой 2' показана расчетная зависимость $S(\theta)$ для 2-го процесса, полученная с помощью уравнения (3) при значениях $S_e = 0,15$ и $S_f = 0,55$, что приблизительно равно экспериментальным значениям коэффициента прилипания в начале 2-го процесса (поверхность покрыта монослоем атомов дейтерия) и в начале 3-го процесса (поверхность покрыта также монослоем молекул D_2 в состоянии 8 К). Для согласования расчетной кривой с экспериментальной подгонялся параметр K_{fe}/K_{fd} .

При моделировании 3-го процесса к правой части уравнения (3) (обозначим ее $f(\theta_3)$) следует добавить член, учитывающий испарение молекул из состояния 5 К:

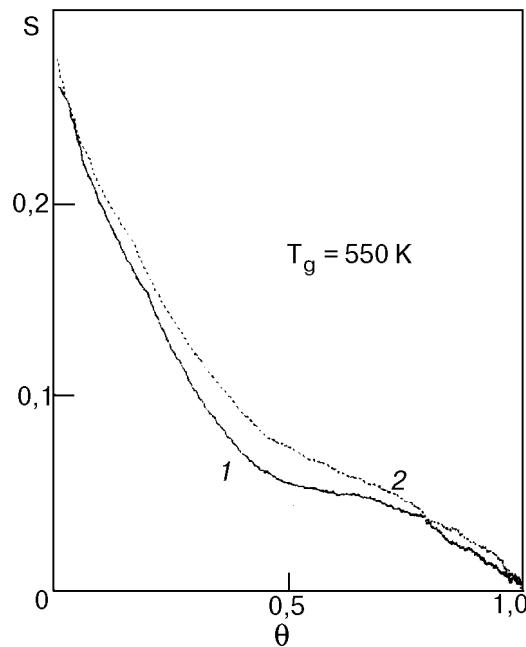


Рис. 3. Зависимость коэффициента прилипания D_2 от степени покрытия при $T_s = 78$ (1) и 300 (2) К.

$$S = f(\theta_3) - K_d n_0 \theta_3 / v, \quad (4)$$

где K_d — константа скорости десорбции; $n_0 \sim 10^{15} \text{ см}^{-2}$ — поверхностная концентрация атомов подложки; $v \sim 10^{13} \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$ — газокинетический поток молекул в нашем эксперименте; θ_3 — степень покрытия в третьем монослое.

Кривой 3' на рис. 1 представлена рассчитанная по уравнению (4) зависимость $S(\theta)$ при $S_e = 0,55$ (что равно экспериментальному значению S в начале 3-го процесса), $S_f = 0,95$, $K_d = (kT/h) \exp(-q/kT)$ (k и h — соответственно постоянные Больцмана и Планка; q — энергия активации десорбции). Используя уравнение (4), предполагаем, что заполнение 3-го монослоя (состояние 5 К) также происходит с участием предсостояния.

Как видно из рис. 1, наблюдается качественное соответствие между экспериментальными и расчетными кривыми, что делает более достоверным предложенное в [13] и в настоящей работе объяснение особенностей зависимости $S(\theta)$ при $T_s \sim 5$ К в различных экспериментальных условиях. Кроме того, из сопоставления экспериментальной и теоретической зависимости $S(\theta)$ для 3-го процесса получено значение вероятности прилипания $S_f = 0,95$ при падении молекулы D_2 на место, занятое молекулой, ранее адсорбированной в состоянии 5 К.

Зависимости $S(\theta)$, измеренные при более высоких температурах подложки (78 и 300 К),

представлены на рис. 3. Естественно, что предельная степень покрытия при указанных температурах достигает лишь единицы, поскольку слабосвязанные адсорбционные фазы при этих температурах нестабильны. В интервале степеней покрытия $0 < \theta < 0,5$ величина S резко уменьшается с увеличением θ , что соответствует ленгмюровскому механизму адсорбции при заполнении атомарного адсорбционного состояния 550 К (см. рис. 2). Второе атомарное состояние 410 К, по-видимому, заполняется с участием предсостояния (скорее всего, это состояние 8 К), о чем свидетельствует замедление спада коэффициента прилипания с ростом θ . Это замедление, как и следовало ожидать [15], более ярко выражено для $T_s = 78$ К, чем для $T_s = 300$ К. С подобным усилением роли предсостояния при понижении температуры подложки мы сталкивались при исследовании адсорбции кислорода на вольфраме [14].

Заключение

В работе обнаружены новые проявления позитивного влияния слабосвязанных состояний физической адсорбции на вероятность прилипания молекул D_2 на поверхности W(110) при низкой температуре. Различия в характере этого влияния в зависимости от условий формирования адсорбированного слоя объясняются в предположении об островковом механизме его роста. Непосредственно из эксперимента и путем сопоставления экспериментальных и расчетных зависимостей $S(\theta)$ определены значения коэффициентов прилипания при падении молекулы D_2 на чистую поверхность ($\sim 0,3$), на поверхность, покрытую монослоем адсорбированных атомов дейтерий ($\sim 0,15$), на поверхность, дополнительно покрытую физически адсорбированным молекулярным монослоем ($\sim 0,55$), а также определена вероятность прилипания молекулы D_2 при ее ударе о ранее адсорбированную молекулу в состоянии 5 К ($\sim 0,95$). Зависимости $S(\theta)$ при повышенных температурах ($T_s > 78$ К) свидетельствуют о реализации двух различных механизмов формирования атомарной фазы адсорбции дейтерия — ленгмюровского и через extrinsic-предсостояние.

Авторы благодарны Государственному комитету Украины по вопросам науки и технологий и INTAS за финансовую поддержку работы.

1. K. Christman, *Surface Sci. Rep.* **9**, 1 (1988).
2. П. П. Луцишин, Т. Н. Находкин, О. Г. Панченко, Ю. Г. Птушинский, *ЖЭТФ* **82**, 1306 (1982).
3. В. В. Гончар, Ю. М. Каган, О. В. Канащ, А. Г. Наумовец, А. Г. Федорус, *ЖЭТФ* **84**, 249 (1983).
4. В. В. Гончар, О. В. Канащ, А. Г. Федорус, *Письма в ЖЭТФ* **38**, 162 (1983).
5. П. П. Луцишин, О. А. Панченко, С. В. Сологуб, *Письма в ЖЭТФ* **41**, 31 (1985).
6. В. В. Гончар, О. В. Канащ, И. А. Котлярова, А. Г. Федорус, А. Ф. Федосенко, *ЖЭТФ* **95**, 1773 (1989).
7. P. P. Lutishin, O. A. Panchenko, and V. F. Shpagin, *Surface Sci.* **278**, 218 (1992).
8. V. F. Koval, P. P. Lutishin, O. A. Panchenko, and S. V. Sologub, *Surface Sci.* **331–333**, 1317 (1995).
9. В. В. Двуреченских, В. Д. Осовский, Ю. Г. Птушинский, В. Г. Сукретный, Б. А. Чуйков, *Письма в ЖЭТФ* **54**, 41 (1991).
10. В. В. Двуреченских, В. Д. Осовский, Ю. Г. Птушинский, В. Г. Сукретный, Б. А. Чуйков, *УФЖ* **37**, 716 (1992).
11. В. А. Чуйков, В. В. Dvurechenskikh, V. D. Osovskii, Yu. G. Ptushinskii, and V. G. Sukretnyi, *Surface Sci.* **285**, 75 (1993).
12. В. Д. Осовский, Ю. Г. Птушинский, В. Г. Сукретный, Б. А. Чуйков, *ФНТ* **19**, 570 (1993).
13. В. Д. Осовский, Ю. Г. Птушинский, В. Г. Сукретный, Б. А. Чуйков, *Письма в ЖЭТФ* **60**, 569 (1994).
14. В. А. Чуйков, V. V. Dvurechenskikh, V. D. Osovskii, Yu. G. Ptushinskii, and V. G. Sukretnyi, *Surface Sci.* **213**, 359 (1989).
15. Ю. Г. Птушинский, Б. А. Чуйков, *Поверхность №9*, 5 (1992).
16. P. W. Tamm and L. D. Schmidt, *J. Chem. Phys.* **54**, 4775 (1971).
17. В. П. Жданов, *Элементарные физико-химические процессы на поверхности*, Наука, Новосибирск (1988).

Molecular adsorption states and sticking probability of D_2 molecules on the W(110) surface at liquid helium temperature

V. D. Osovskii, Yu. G. Ptushinskii, V. G. Sukretnyi, and B. A. Chuikov

The sticking probability of D_2 molecules on the W(110) surface versus coverage degree is measured at a substrate temperature $T_s \sim 5$ K for different conditions of adlayer formation. It has been earlier (V. D. Osovskii et al., *Pis'ma Zh. Eksp. Teor. Fiz.* **60**, 569 (1994)) found that the sticking probability of D_2 increases appreciably with populating weakly bound physical adsorption states. This effect becomes more pronounced on a surface covered by an ordered monolayer of deuterium atoms and even much more on a surface covered by atomic and physisorbed molecular monolayers. The peculiarities of $S(\theta)$ at $T_s \sim 5$ K may be treated with due account of the island mechanism of adlayer growth and the involvement of the precursor in its formation.